

Система прямой оптической литографии POLOS μ Writer

Система прямой оптической литографии POLOS μ Writer

Производитель:

SPS Europe

Цена:

Цена по запросу

Описание

POLOS μ Writer является бюджетным настольным решением для прямой литографии на фотошаблонах и подложках при требованиях к разрешению до 8мкм. Источником излучения является классический ультрафиолетовый твердотельный лазер с длиной волны 405нм, прекрасно подходящий для экспонирования большинства фоторезистов. Система обладает набором объективов, позволяющих оператору регулировать соотношение скорость/разрешение в широких пределах. Вся установка занимает один стол и не требует сложной инфраструктурной обвязки, для ее работы необходимо только электричество.

Данная система прекрасно подойдет для исследовательских институтов, лабораторий, мелко и среднесерийных производств. На установке можно экспонировать как фотошаблоны, так и подложки размером до 102x102мм.

Источник излучения	Твердотельный УФ лазер
Длина волны	405нм
Максимальный размер заготовки	102x102мм
Максимальная область экспонирования	100x92мм
Скорость экспонирования	1,7 - 21,2 мм ² /мин (зависит от выбора объектива и режима экспонирования)
Автофокус	Есть
Камера для распознавания меток	Есть

Возможность использования установки в качестве оптического микроскопа	Есть
Система управления	ПК
Электропитание	220 В, 50 Гц 16А
Габариты (ШхГхВ)	510х360х455 мм